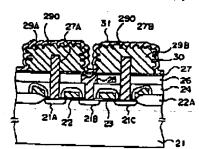
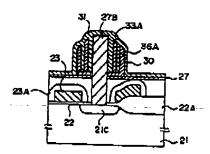
【図4】

本質的の書き支持例による半導体衛星の環境を永寸的



【図7】

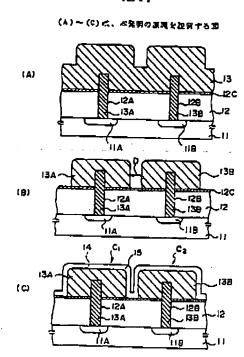
不発気のある実活気による中語体質量の時度を示す際



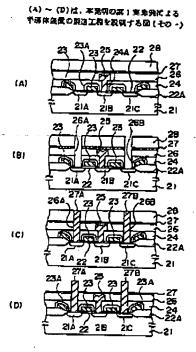
(11)

特開平10-289986

[図1]

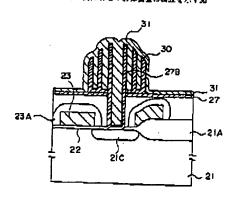


[閏2]



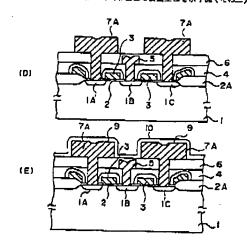
(Ø10)

- 本発列の記号 実施例による予測を質量の構立を示す項



[XI4]

(D)、(E)は、従来の下導体医室の製造工程を示す数(その二)

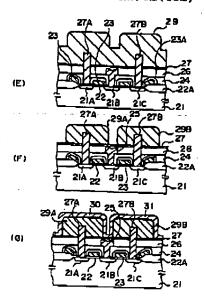


(22)

特闘平10-289988

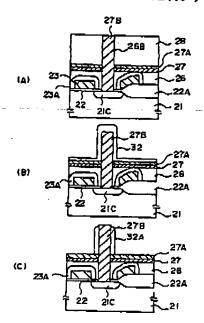
[図3]

(E) ~ (G) は、不覧例の第1実治的による 半球体装置の製造工程を製明する限(その二)



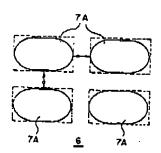
【図5】

(A)~(C)以、本発明の表3支元円による 半導体経費の製造工程を以明する図(その一)



【図15】

住夫の工程で形成したメモリセルキャパショの形状を示す中間頭

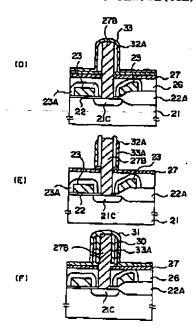


(13)

特明平10-289988

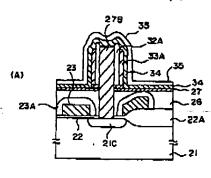
[図6]

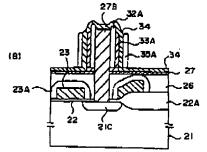
(D)~(F)は、本意明の第5美力的による 中条体英量の契迫工事を説明する強(その二)



【図8】

(A),(B)は、半発明第4実施制による半省 体質量の製造工程を契例する関(その・)



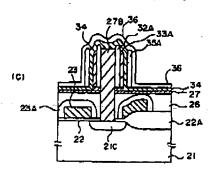


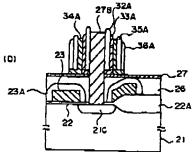
(14)

特閑平10-289986

[29]

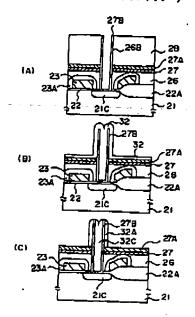
(C). (D)は、本党明第4実施技術とよる単純 体型産の整理工程を投明する数(その二)





[2]11]

(A)~(C)は、本処労済 5 天恵保による中澤 体気者の見近江程を堅明する忠(その~)



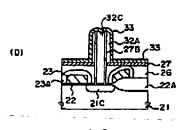
P.31

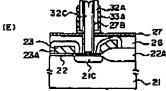
(15)

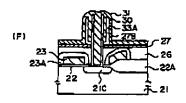
特開平10-289986

【図12】

(0)~(f)は、本発明点5美差例だよるギ基体変素の製造工程を設備する数(その二)







{**図**13]

(A)ー(C)は、変求の不確体設置の製造工具を示す図 (その一)

